

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 3 月 9 日 (2006.3.9)

【公開番号】特開 2005-203382 (P2005-203382A)

【公開日】平成 17 年 7 月 28 日 (2005.7.28)

【年通号数】公開・登録公報 2005-029

【出願番号】特願 2005-107009 (P2005-107009)

【国際特許分類】

H 0 1 J 37/28 (2006.01)

H 0 1 J 37/20 (2006.01)

H 0 1 J 37/317 (2006.01)

【F I】

H 0 1 J 37/28 B

H 0 1 J 37/20 A

H 0 1 J 37/317 D

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 1 月 20 日 (2006.1.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

試料室内における微小試料加工観察方法であって、

試料台に載置された試料に、イオンビームを照射して微小試料を摘出し、

微小試料を、イオンビーム及び電子ビームの微小試料への照射角度を変更する照射角度変更手段に固定し、

照射角度変更手段に固定されている微小試料にイオンビームを照射し、観察断面を形成し、

電子ビームに対して観察断面が略垂直の角度となるよう、照射角度変更手段により電子ビームの微小試料への照射角度を変更し、

照射角度変更手段に固定された微小試料に電子ビームを照射し、観察断面を測定する方法。